(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. November 2001 (15.11.2001)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/86276 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G0 H05K 1/00
- G01N 27/403,
- (21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/05032

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. Mai 2001 (04.05.2001)

(25) Einreichungssprache:

14

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 23 015.6

5. Mai 2000 (05.05.2000) DE -

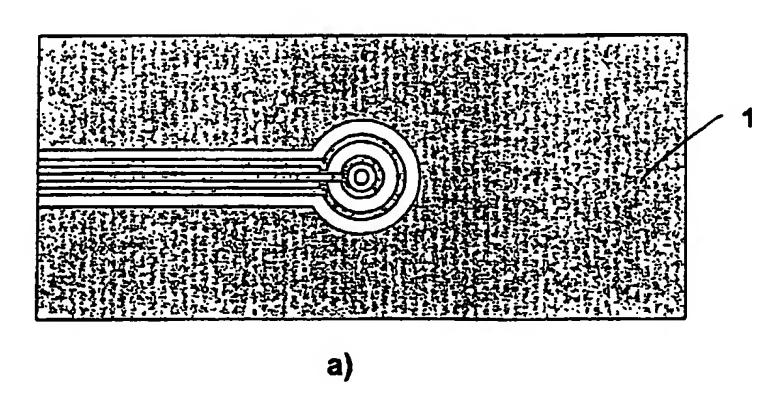
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INSTITUT FÜR CHEMO- UND BIOSENSORIK MÜNSTER E.V. [DE/DE]; Mendelstrasse 7, 48149 Münster (DE).

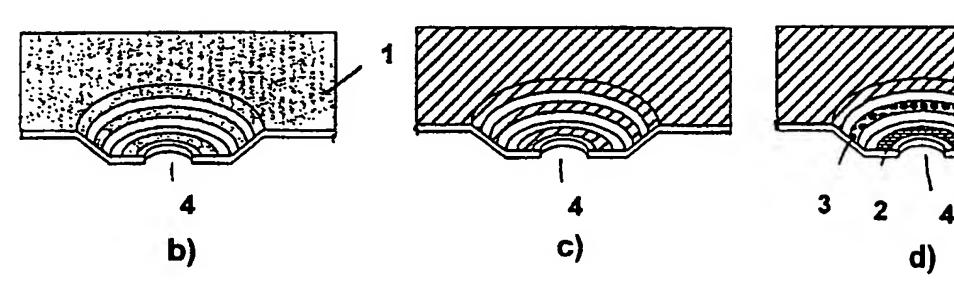
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (mur für US): BORCHARDT, Michael [DE/DE]; Offlum 41, 48485 Neuenkirchen (DE). WENDZINSKI, Frank [DE/DE]; Königsberger Weg 2, 48291 Telgte (DE).
- (74) Anwalt: PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR; Kurfürstendamm 170, 10707 Berlin (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF A THREE-DIMENSIONAL SENSOR ELEMENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DREIDIMENSIONALEN SENSORELEMENTES





(57) Abstract: A method for the production of a three-dimensional sensor element with a support, upon which metallic electrode surfaces are applied, is disclosed. A malleable primer paste is applied to the initially flat support, for the modelling of the electrode surfaces. The support with the primer paste is then moulded in three-dimensions, the primer paste provided for the electrode surfaces is metallised and in at least one cavity a material recognition and/or replacement substance is applied.





(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Sensorelementes mit einem Träger, auf den metallische Elektrodenflächen aufgebracht werden, vorgeschlagen. Dabei wird eine modellierbare Primerpaste auf den zunächst planaren Träger zur Strukturierung der Elektrodenflächen aufgebracht. Anschließend wird der mit Primerpaste versehene Träger dreidimensional verformt und die die Elektrodenflächen vorgebende Primerpaste metallisiert und in mindestens eine Kavität wird eine stofferkennende und/oder -umsetzende Substanz eingebracht.

10

15

20

## Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Sensorelementes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Sensorelementes nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.

Als Sensoren sind z.B. elektrochemische Sensoren bekannt, die üblicherweise eine planare Struktur aufweisen und einen Träger, beispielsweise aus Kunststoff oder Glas umfassen, auf den Elektroden, beispielsweise elektrochemisch abgeschieden werden. Je nach Verwendungszweck werden weitere Schichten aufgebracht, auf denen biologische Komponenten immobilisiert werden, oder die als sensitive Membranen ausgebildet sind.

Die elektrochemischen Sensoren nach dem Stand der Technik weisen den Nachteil auf, daß dreidimensionale Sensorstrukturen vielfach nicht realisierbar sind, da

10

15

20

25

30

35

eine feinstrukturierte Metallisierung auf nichtplanaren Flächen nach dem Stand der Technik nur sehr aufwendig oder gar nicht möglich ist. Weiterhin fehlt es
den planaren Sensoren oft an Halt für sensitive Membranen und oft können biologische Komponenten zur
Herstellung von Biosensoren nicht ausreichend mechanisch stabilisiert werden.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Sensorelementes zu schaffen, mit dem einfach und preiswert dreidimensionale Sensorstrukturen für die Massenproduktion herstellbar sind.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruchs in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs gelöst.

Dadurch, daß eine modellierbare Primerpaste zur Strukturierung der Elektroden auf den Träger aufgebracht wird, der mit Primerpaste versehene Träger anschließend dreidimensional entsprechend der gewünschten Form verformt wird und anschließend die die Elektrodenflächen vorgebende Primerpaste selektiv metallisiert wird und stofferkennende und/oder -umsetzende Substanzen in mindestens eine Formteilkavität eingebracht werden, wird ein einfaches, preiswertes und massenproduktionstaugliches Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Sensoranordnungen geliefert. Die Formgebung, Stabilisierung und Kontaktierung der Sensoren ist mit nur einem Werkstück möglich, wobei mehrere Sensoren oder Zusatzteile, wie Fluidikteile, beispielsweise im Spritzgußverfahren zu Sensorsystemen kombiniert und miteinander einstückig verbunden werden können. Durch die aufgrund der Formgebung gelieferten Hohlräume und Kavitäten des dreidimensiona-

10

15

20

25

30

35

len Formteils können biologische Komponenten und sensitive Membrane sehr gut mechanisch fixiert werden.

Es können eine Vielzahl von stöfferkennenden und/oder umsetzenden Substanzen verwendet werden, z.B. Mikro-organismen, metallische Katalysatoren, Antikörper, Enzyme, DNA-Fragmente oder dergleichen.

Durch die in den Unteransprüchen angegebenen Maßnahmen sind weitere vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen möglich.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen

- Fig. 1 eine Ansicht auf und einen perspektivischen Schnitt durch eine Sensoranordnung in den verschiedenen Verfahrensabschnitten,
- Fig. 2 mehrere Verfahrensschritte zur Herstellung eines amperometrischen Enzymsensors,
- Fig. 3 mehrere Verfahrensschritte zur Herstellung einer als potentiometrische Elektrode ausgebildeten Sensoranordnung,
  - Fig. 4 eine Unteransicht und eine Schnittansicht eines Bechers mit mehreren Sensoranordnungen.
  - Fig. 5 eine schematische Schnittansicht eines in eine Durchflußmeßzelle integrierten Sensors, und

PCT/EP01/05032

Fig. 6 Verfahrensablauf der Herstellung eines Harenstoffsensors.

In Fig. 1 sind verschiedene Herstellungsschritte einer elektrochemischen Sensoranordnung nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Entsprechend Fig. 1a) wird für die Herstellung einer elektrochemischen Sensoranordnung auf einen Träger 1 ein Mittel für die Strukturierung der für die Sensoranordnung verwendeten Elektroden und elektrischen Zuführungen zu den Elektroden, die insgesamt als Leiterbahnen und elektrische Kontaktflächen ausgebildet sind, aufgebracht. Dabei können die Elektroden gleichzeitig Sensorelemente darstellen. Der Träger 1 weist formbare Eigenschaften auf und besteht beispielsweise aus Kunststoff, vorzugsweise wird eine tiefziehfähige Folie aus Polycarbonaten, Acrylnitrit-Butadien-Styrol-Copolymeren und Polyethylen (PC, ABS, PE) verwendet.

20

25

15

5

10

Das Mittel für die Strukturierung der Elektroden ist eine Primerpaste, die die gewünschte Elektrodenform mit Zuführungen vorgibt. Die Paste beinhaltet Reduktionsmittel zur chemisch reduktiven Abscheidung von z.B. Kupfer oder Nickel. Weiterhin muß der Primer nach dem Aufbringen und vor dem Metallisieren konditioniert werden, z.B. 1 h bei T = 150°C, wobei die Paste dann auch durchgehärtet ist. Sie läßt sich nach dem Konditionieren thermisch verformen.

30

35

Die Strukturierung des späteren dreidimensionalen Sensorkörpers beginnt bereits auf dem ebenen Substrat oder Träger 1. Das Beschichtungsverfahren wird so gewählt, daß nach der späteren Verformung ein ausreichender kurzschlußsicherer Abstand zwischen den einzelnen Sensorflächen bzw. Elektroden und Zuführungen

10

15

20

25

30

35

vorhanden ist. Bei der Beschichtung mit der Primerpaste muß bedacht werden, daß eine Verformung der aufgebrachten Fläche erfolgt. Die spätere dreidimensionale Struktur muß vor dem Aufbringen berechnet werden. Der Träger wird genau dort beschichtet, wo später die Metallisierung des dreidimensionalen Sensorkörpers vorgenommen wird. Als Beschichtungsverfahren eignen sich z.B. Besprühen oder Bedrucken, wobei das Siebdruckverfahren eine millimetergenaue zweidimensionale Beschichtung mit der Primerpaste ermöglicht. Dabei kann ein weitgehend automatisiertes Beschichtungsverfahren entsprechend der modernen Siebdrucktechnologie vorgenommen werden.

Nach dem Aufbringen der Paste wird die Anordnung getrocknet bzw. konditioniert, wobei die Paste aushärtet.

In einem weiteren Schritt, dessen Ergebnis in Fig. 1b) gezeigt wird, wird der Träger 1 dreidimensional verformt und bildet einen dreidimensionalen Sensorkörper bzw. ein dreidimensionales Formteil. Dazu wird eine Warmverformung durchgeführt, bei der der Träger in den weichelastischen Zustand erwärmt, unter geringer Kraft verformt und danach bei anhaltender Verformungskraft unter den Einfrierbereich abgekühlt wird. Dabei können verschiedene Wärmequellen, wie Infrarotflächenstrahler, Wärmeschränke, Heißluft und Heißwasser verwendet werden. Für den Verformungsprozess sind mehrere Verfahren denkbar, wie Formstanzen, Prägen, Druckluftverfahren oder Vakuumverfahren. Welches Verfahren letztendlich zur Anwendung kommt, hängt im Wesentlichen von den Abmessungen der Sensorik sowie von der Struktur des Sensors ab. Im Ausführungsbeispiel wird das Formen des Sensorkörpers oder Formteils durch Thermoverformung durchgeführt. Die Primerpaste

10

15

20

25

30

35

läßt sich gleichfalls verformen, so daß keine Risse oder dergleichen Beschädigungen auftreten können. Grundsätzlich muß bei der Prozessführung darauf geachtet werden, daß die Primerschicht in ungefähr gleicher Dicke und Homogenität bestehen bleibt.

Nach dem dreidimensionalen Verformen wird eine chemische oder elektrochemische Metallisierung der Elektrodenflächen und Leiterbahnen vorgenommen. Alle elektrochemischen Sensoren arbeiten mit elektrisch leitenden Oberflächen, wobei die gängigen elektrochemischen Bestimmungsmethoden häufig ein Differenzverfahren verwenden, d.h. es wird die Änderung eines elektrischen Effektes zwischen einer Arbeits- und einer Referenzelektrode bestimmt. Dies wiederum bedingt, daß beide Elektroden räumlich getrennt sein müssen. Die räumliche Trennung wiederum führt zur Isolation der Elektroden. In dreidimensionalen Sensorstrukturen ist die Realisierung voneinander getrennter Elektroden technisch sehr aufwendig. Bei den Technologien nach dem Stand der Technik wird die Beschichtung des Elektrodenraums mit elektrisch leitfähigem Material erst nach der Ausformung einer dreidimensionalen Struktur durchgeführt. Bei der strukturierenden Metallisierung von Hohlkörpern wird z.B. mit Maskentechnologien gearbeitet, wobei die Anwendung von Masken eine hohe Maßhaltigkeit der dreidimensionalen Grundkörper erfordern. Häufig ist auch die mechanische Nachbearbeitung der Grundkörper notwendig.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann nach Aufbringen der Primerpaste und der Verformung des Grundkörpers mit der Metallisierung begonnen werden. Die chemische Metallabscheidung dient dem Leitendmachen der mit dem Primer versehenen Kunststofffläche. Dazu

kann das Werkstück z.B. in reduktiven ChemischKupfer- oder Chemisch-Nickel-Bädern mit einer relativ
dünnen, den Strom leitenden Schicht versehen werden.
Diese wiederum kann elektrolytisch durch Abscheidung
weiteren Metalls verstärkt werden. Im Falle, daß die
Primerpaste elektrisch leitend ist, kann direkt auf
der Paste eine elektrochemische Metallabscheidung
stattfinden.

Zur Aktivierung der Oberfläche wurde die thermoverformbare Primerpaste aufgebracht, die katalytisch
wirkende Substanzen beinhaltet. Die reduktive Metallisierung läßt sich durch die folgende Gleichung beschreiben:

15

20

25

30

35

10

5

$$Me^{z^+} + Re^{n^+} \rightarrow Me^{0} + Re^{(n+z)^+}$$

 $Me^{z^{+}}$  = das gelöste Metallion mit der Ladung z+  $Re^{n^{+}}$  = das Reduktionsmittel mit der Ladung n+  $Me^{0}$  = das reduzierte, abgeschiedene Metall  $Re^{(n+z)^{+}}$  = das oxidierte Reduktionsmittel

Durch dieses Verfahren lassen sich im Grunde alle Nichtleiter nach Aufbringen der Aktivierungsschicht, d.h. der Primerpaste und der Thermoverformung metallisieren. Die Schichtdicke des Metalls ist dabei an jeder Stelle, die von dem Elektrolyten benetzt wurde, gleich. Die größte Bedeutung bei der chemisch reduktiven Metallisierung haben Nickel- und Kupferbäder. Die Zusammensetzung eines chemischen Verkupferungsbades besteht in der Regel aus ionischem Kupfer, einem Reduktionsmittel, basischen Komponenten und Komplexbildnern. Als Reduktionsmittel dient z.B. Formaldehyd. Im folgenden ist die chemische Hauptreaktion bei der Metallabscheidung aufgeführt:

$$Cu^{2+} + 4OH^{-} + 2HCHO \rightarrow Cu^{0} + 2HCOO^{-} + H_2 + 2H_2O$$

Je nach Zusammensetzung des Bades wird eine Schicht-dickenzunahme von 0,3 bis 10 µm/h erhalten. Bei der chemischen Vernickelung von Kunststoffen wird als Reduktionsmittel überwiegend Natriumhypophosphit (NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>) verwendet. Das Redoxpotential liegt bei -1,4 V. Die chemische Hauptreaktion bei der Metallabscheidung läßt sich wie folgt beschreiben:

10

15

20

5

$$3NaH_2PO_2+3H_2O+NiSO_4\rightarrow 3NaH_2PO_2+H_2SO_4+2H_2+Ni^0$$

Als Nebenprodukt entsteht Phosphor, der in die Nikkelschicht mit eingebaut wird. Die optimale Beschichtungsgeschwindigkeit liegt zwischen 2 und 10 µm/h. Um die bei der chemischen Metallabscheidung aufgebrachten Kupfer- oder Nickelschichten zu verstärken oder zu modifizieren, können nun weitere Metalle elektrolytisch darauf abgeschieden werden. Die zu beschichtende Fläche dient bei der elektrochemischen Reduktion als Kathode. Die kathodische Reaktion läßt sich wie folgt beschreiben:

$$Me^{n+} + n+e^{-} \rightarrow Me^{0}$$

25

Wenn mit löslichen Anoden gearbeitet wird, ist der elektrochemische Vorgang an dieser Elektrode wie folgt:

30

35

$$Me^0 \rightarrow Me^{n+} + n*e^-$$

Nach der Beschichtung werden die Überzüge gereinigt. Als Metalle für die elektrolytische Metallabscheidung dienen z.B. Kupfer, Nickel, Chrom, Zinn, Messing, Schwarzchrom usw. Für die Entwicklung von chemischen Sensoren werden überwiegend Metalle wie Silber, Gold

10

15

20

25

30

35

und Platin verwendet.

Ein alternatives Verfahren zur Strukturierung von Elektroden ist die sogenannte Partielle Galvanisierung, wie sie z.B. auch für die Herstellung gedruckter Schaltungen verwendet wird.

In Fig. 1c) ist die Metallisierung bzw. sind die Elektrodenflächen durch die Linienschraffur zu erkennen.

Fig. 1d) stellt zwei Elektroden 2, 3 dar, die zwei unterschiedlichen Elektrodentypen angehören. Im Falle einer Ausbildung als amperometrischer Sensor sind die Elektroden 2, 3 z.B. eine Platin-Arbeitselektrode und eine Ag/AgCl-Referenzelektrode. In der Fig. 1b), 1c), 1d) ist mittig eine Durchbrechung bzw. ein Loch 4 vorgesehen, das die Kontaktierung mit der Meßlösung ermöglicht. Die Sensoranordnung kann mit einem Fluidikteil (nicht dargestellt) versehen sein, das beispielsweise ein mit einem oder mehreren Kanälen versehenes Kunststoffteil ist, das mit einem Spritzgußverfahren direkt an den verformten Träger 1 bzw. an das Formteil angespritzt werden kann. Auf diese Weise läßt sich die dargestellte Sensoranordnung in andere Systeme einbinden. Beispielsweise läßt sich der Sensor einbinden in die Durchflußmeßzellen, Fließinjektionsanalyse-Systeme, Sensorstreifen oder andere Kombinationen. Neben dem Spritzgießen gibt es weitere Verfahren zur Verknüpfung der dreidimensionalen Sensoren mit z.B. einer Fluidik. Diese Verfahren lassen sich als "Kleb- und Fügtechniken" zusammenfassen.

In die Formteilkavität lassen sich sensitive Substanzen einbringen oder biologische Komponenten immobilisieren, beispielsweise können Enzymmembranen und/oder

ionenselektive Membranen eingebracht werden, wodurch Biosensoren realisiert werden. Grundsätzlich müssen die Komponenten, die das Wesen des Sensors bestimmen, nach der Thermoverformung in die dreidimensionale Sensorstruktur eingebracht werden.

In dem in Fig. 1 beschriebenen Ausführungsbeispiel wurde als Träger eine modellierbare, formstabile Folie verwendet. Selbstverständlich kann auch ein anderes Material für den Träger eingesetzt werden, beispielsweise ein leitendes oder nicht leitendes Metall. Weiterhin kann der Träger verschiedene pyhsikalische Eigenschaften aufweisen, die für die Funktionalität des Sensors von Bedeutung sind. So kann der Träger als elektrischer Isolator wirken, elektrisch leitend sein, für bestimmte Substanzen permeabel sein und bestimmte mechanische, optische oder akustische Eigenschaften besitzen. Ein für Gas permeables Material ist beispielsweise Teflon. Als Dialysemembrane ausgebildete Träger sind für in Lösung befindliche Substanzen permeabel.

In Fig. 2 ist ein Verfahren zur Herstellung eines amperometrichen Enzymsensors in einer Drei-Elektrodenanordnung dargestellt. In Fig. 2A) ist ein planares
thermoverformbares Kunststoffsubstrat 10 zu erkennen,
das in Fig. 2B) mit einer Primerpaste 11 entsprechend
der gewünschten Struktur der drei Elektroden beschichtet wird. In Fig. 2C) wird die gesamte Anordnung verformt, z.B. durch das Formstanzen, bei dem
der erwärmte primerbeschichtete Kunststoff 10, 11
zwischen einem Stempel und ein Gesenk gepreßt wird.
Er kühlt im ungeheizten Werkzeug unter Spannung ab.
Im Schritt 2D) wird das Formteil 12 bearbeitet, im
dargestellten Ausführungsbeispiel wird durch Laserbohren eine Öffnung 13 eingearbeitet. Im Schritt 2E)

wird das Formteil 12 mit Kunststoffmasse 15 hinterspritzt, derart, daß ein mit der Öffnung 13 in Verbindung stehender Kanal 14 gebildet wird. Anschließend wird entsprechend 2F) das Formteil 12 mit der hinterspritzten Kunststoffmasse 15 an den Stellen metallisiert, an denen sich der Primer 11 befindet, danach wird mit dem gewünschten Metall galvanisiert und durch Chloridisierungen eine Referenzelektrode hergestellt, z.B. aus einer Silberfläche eine Ag/AgCl Referenzelektrode gebildet. Entsprechend Schritt 2G) wird die Kavität des Formteils 12 mit angespritzter Kunststoffmasse 15 mit einem Enzymgel 16 befüllt und die Enzymschicht 16 wird anschließend durch eine Versiegelungsschicht 17, z.B. aus einem UV- oder RTVhärtenden Silicon- oder Acrylatkleber abgedeckt (Schritt 2H)). Das entsprechend Fig. 2 gefertigte Bauteil stellt beispielsweise einen Bestandteil einer Durchflußmeßzelle dar. Ein solcher Sensor mit Durchflußmeßzelle ist in Fig. 5 beispielhaft dargestellt.

20

25

30

35

5

10

15

In Fig. 3 ist die Herstellung eines potentiometrischen Sensors dargestellt, wobei die Schritte ähnlich zu denen nach Fig. 2 sind. Ein thermoverformbares Kunststoffsubstrat 20(A)) wird mit einer Primerpaste 21 beschichtet (B)) und entsprechend C) zu einem Formteil 22 verformt. Die Primerbeschichtung 21 erstreckt sich im Wesentlichen über das ganze Kunststoffsubstrat 20. In Fig. 3D) wird das Formteil 22 bearbeitet, indem eine Öffnung 23 sowohl durch die Primerschicht 21 als auch durch das Substrat 20 vorzugsweise durch Laserbohren eingearbeitet wird. In Fig. 3E) wird das Formteil 22 mit Kunststoffmasse 25 hinterspritzt und entsprechend F) wird eine Metallisierung an den Stellen, an denen sich der Primer befindet, vorgenommen, und anschließend wird die Metallisierung mit dem gewünschten Metall galvanisiert.

WO 01/86276

5

10

15

20

25

30

35

PCT/EP01/05032

12

Nach Schritt G) wird die Kavität mit einer ionenselektiven Membrane 26 befüllt. In einem anderen Ausführungsbeispiel findet eine Befüllung mit beispielsweise Ag/AgCl zur Herstellung einer Referenzelektrode statt.

In Fig. 4 ist die Anwendung einer dreidimensionalen Sensoranordnung bei einem Becher dargestellt, wobei sowohl die Unterseite als auch ein Schnitt sowie eine vergrößerte Darstellung des Sensors vorgesehen sind. In die Unterseite eines Bechers 30 sind vier Sensoranordnungen 31 eingeformt, die jeweils über eine Öffnung 32 mit dem inneren des Bechers verbunden sind. Ein solcher Becher 30 kann zur einmaligen Messung benutzt werden. Der Becher wird im Thermoformverfahren hergestellt und ist z.B. mit ionenselektiven Elektroden sowie Referenzelektroden versehen. Die Verwendung eines solchen Bechers ist z.B. für medizinische Untersuchungen denkbar, beispielsweise können mit einem sensorbestückten Urinbecher sehr schnell harnpflichtige Substanzen bestimmt werden. Dazu sind Sensoren zur Bestimmung des pH-Wertes, der Elektrolyte und der Metabolite im Becher integriert.

Eine weitere Anwendung ist beispielsweise ein Joghurtbecher, bei dem mit einer integrierten Sensoranordnung, z.B. einem pH-Sensor ein Aufschluß über die Reife oder den Verderb des Produktes erzielt werden kann.

In den obigen Ausführungsbeispielen diente die Primerpaste zur Herstellung einer selektiven Metallabscheidung, es ist jedoch auch denkbar, daß sie zum chemischen oder elektrochemischen Auf- oder Einbringen von Polymeren verwendet wird.

10

15

20

25

30

35

### Beispiel:

Im folgenden wird als Beispiel die Herstellung und Anwendung eines dreidimensionalen Harnstoffsensors beschrieben (Fig. 6).

Mit Hilfe der modellierbaren Primerpaste 40 für die chemisch reduktive Abscheidung einer Metallschicht werden die Strukturen des Sensors im Siebdruckverfahren auf eine Polycarbonatfolie 41 gebracht. Die Primerpaste gibt die gewünschte Sensorform mit Ableitung vor (Fig. 6a). Nach der thermischen Konditionierung wird die Folie mit aufgebrachter Paste mit Vakuum thermoverformt. Es wird ein dreidimensionaler Sensorkörper erhalten. Die Sensorstrukturen werden chemisch mit Kupfer 42 metallisiert (Fig. 6b) und zwar ausschließlich an den Stellen, an denen sich der Primer befindet. In die gebildete Kavität 44 wird eine Öffnung 43 gebohrt. Die mit den metallisierten Sensorstrukturen bestückte Folie wird zur Verkapselung mit einer Polyester-Heißklebefolie mit einem Laminiergerät unter Druck und Wärme vollständig verschlossen.

Die Formteilkavität 44 werden über die Bohrung zunächst eine ammoniumsensitive PVC-Membran 46 (Fig. 6c) und anschließend ein Gel 47, welches Urease enthält, eingebracht (Fig. 6d).

Für Harnstoffsensoren werden ammoniumsensitive Elektroden als Transducer eingesetzt, die mit einer biologisch aktiven Komponente gekoppelt werden. Das Meßprinzip des Einwegsensors basiert auf der enzymatischen Spaltung des Harnstoffs durch immobilisierte Urease. Das Enzym katalysiert die Hydrolyse des Harnstoffs zu Hydrogencarbonationen und Ammoniumionen.

• WO 01/86276 PCT/EP01/05032

Mit Hilfe des hergestellten Biosensors werden die Ammoniumionen bestimmt.

Die Zusammensetzung des PVC-Membrancocktails zur Herstellung ammoniumsensitiver weist Sobacinsäure-bis-2-ethylhexylester, Polyvinylchlorid (PVC) und Nonactinauf.

5

10

15

20

25

Zur Herstellung der Membran werden die Komponenten in einem Präparateglas eingewogen und durch Schwenken in organischen Lösungsmitteln gelöst. Als Lösungsmittel werden Tetrahydrofuran und Cyclohexanon im Verhältnis 3:1 verwendet. Bis zur vollständigen Lösung der Komponenten wird der Cocktail bei Raumtemperatur über Nacht stehengelassen.

Der auf diese Art und Weise erhaltene homogene zähflüssige Membrancocktail wird mit einem Dispenser manuell in die Kavität des Sensorrohlings eingeracht.
Die Kavität wird vollständig mit Cocktail befüllt.
Nach 24 h ist die Membran ausgehärtet.

Die biologische Komponente wird in Form einer Hydrogellösung in die Kavität gebracht. Dazu wird vorher das Enzym Urease in einem noch nicht polymerisierten Gelmaterial gelöst. Anschließend wird das Gel in die Kavität dispensiert und zur Polymerisation gebracht. Das Enzym ist in dem Gel immobilisiert.

Die hergestellten Sensoren werden unter Verwendung eines Aufstockverfahrens kalibriert und anschließend als Einweg-Harnstoffsensoren verwendet.

10

15

20

25

30

#### Patentansprüche

 Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Sensorelementes mit einem Träger, auf den metallische Elektrodenflächen aufgebracht werden,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

Aufbringen einer modellierbaren Primerpaste auf den zunächst planaren Träger zur Strukturierung der Elektrodenflächen, dreidimensionales Formen des mit Primerpaste versehenen Trägers zu einem Formteil und Metallisieren der die Elektrodenflächen vorgebenden Primerpaste, Ein- oder Aufbringen von stofferkennenden und/oder -umsetzenden Substanzen in mindestens eine Kavität des dreidimensional verformten Trägers.

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Primerpaste vor dem dreidimensionalen Formen gehärtet wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das dreidimensionale Formen durch Thermoverformung realisiert wird.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallisierung
  chemisch oder elektrochemisch auf die Primerpaste aufgebracht wird.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Primerpaste mittels Printverfahren, z.B. Siebdruck auf den Träger aufgebracht wird.

10

15

20

25

30

- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Träger ein Elastomer, eine modellierbare, formstabile Folie oder leitendes oder nicht leitendes Metall verwendet wird.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger als Isolator ausgebildet ist und/oder für bestimmte Substanzen und/oder für in Lösung befindliche Substanzen und/oder für Gase permeabel ist.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die in mindestens eine durch das dreidimensionale Formen entstehende Formteilkavität eingebrachten Substanzen, sensitive Substanzen und/oder biologische Komponenten sind.
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß eine Enzymmembran und/oder eine ionenselektive Membran eingebracht wird.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß als stofferkennende und/oder -umsetzenden Substanzen metallische Katalysatoren, Mikroorganismen, Enzyme, Antikörper und/oder DNA-Fragmente oder dergleichen in die mindestens eine Formteilkavität eingebracht werden.
  - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der dreidimensionale
    Träger vor oder nach dem Metallisieren mit einem
    Fluidikteil verbunden wird.
  - 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluidikteil mit einem Spritzgußver-

' WO 01/86276 17

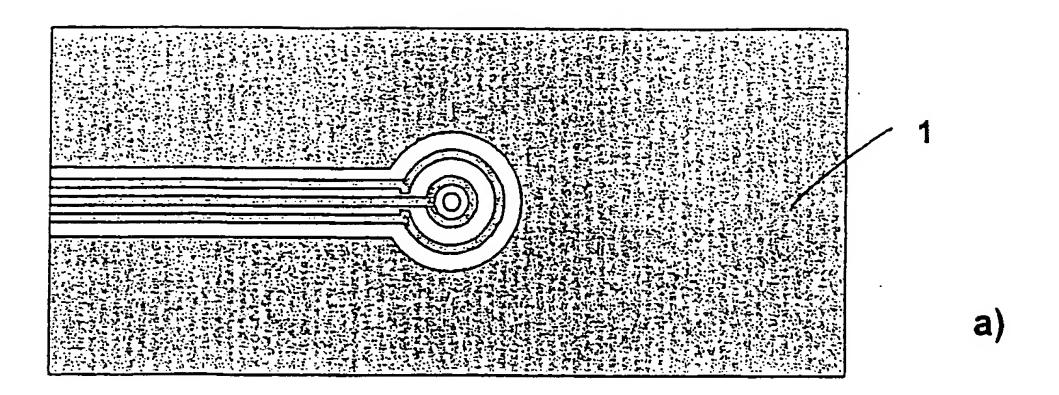
5

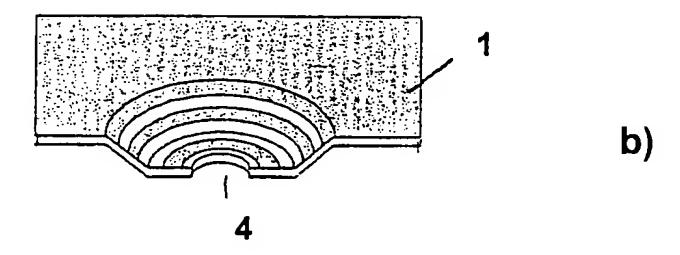
fahren an dem Träger angespritzt wird.

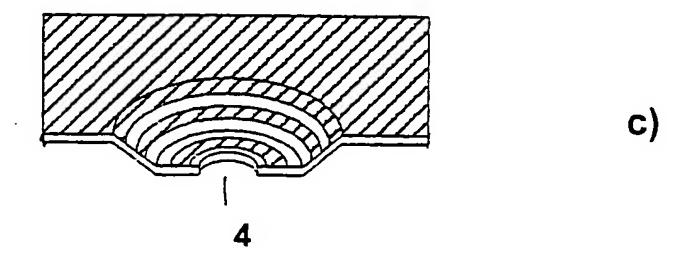
13. Elektrochemischer Sensor, hergestellt nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

PCT/EP01/05032

14. Biosensor, hergestellt nach einem der Ansprüche 1 bis 12.







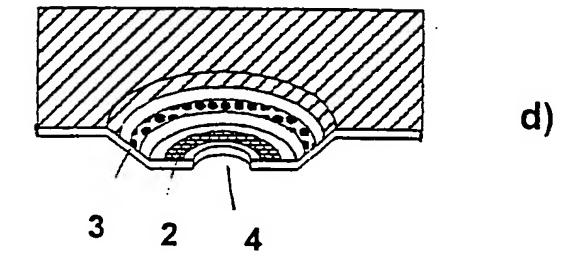
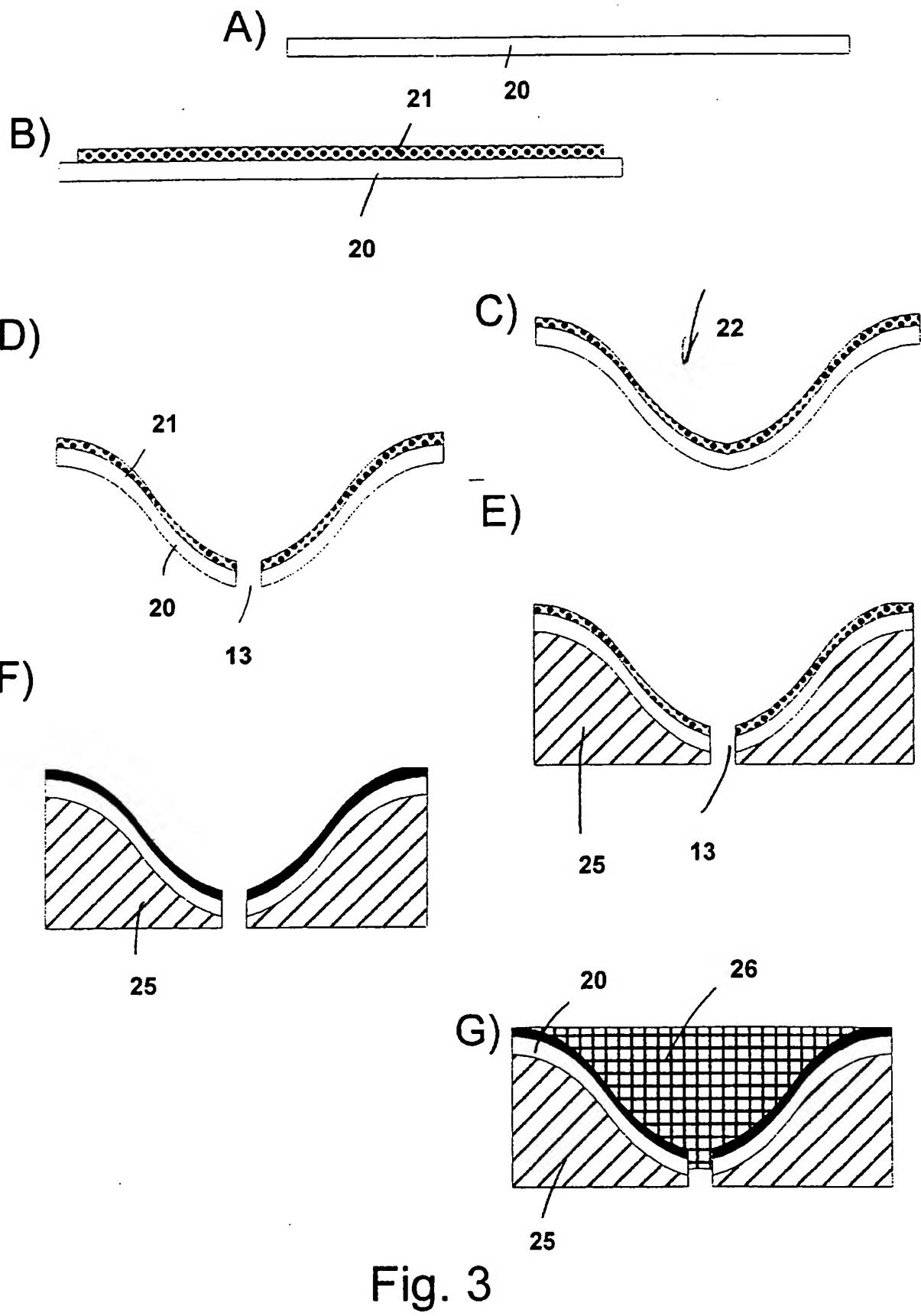


Fig. 1



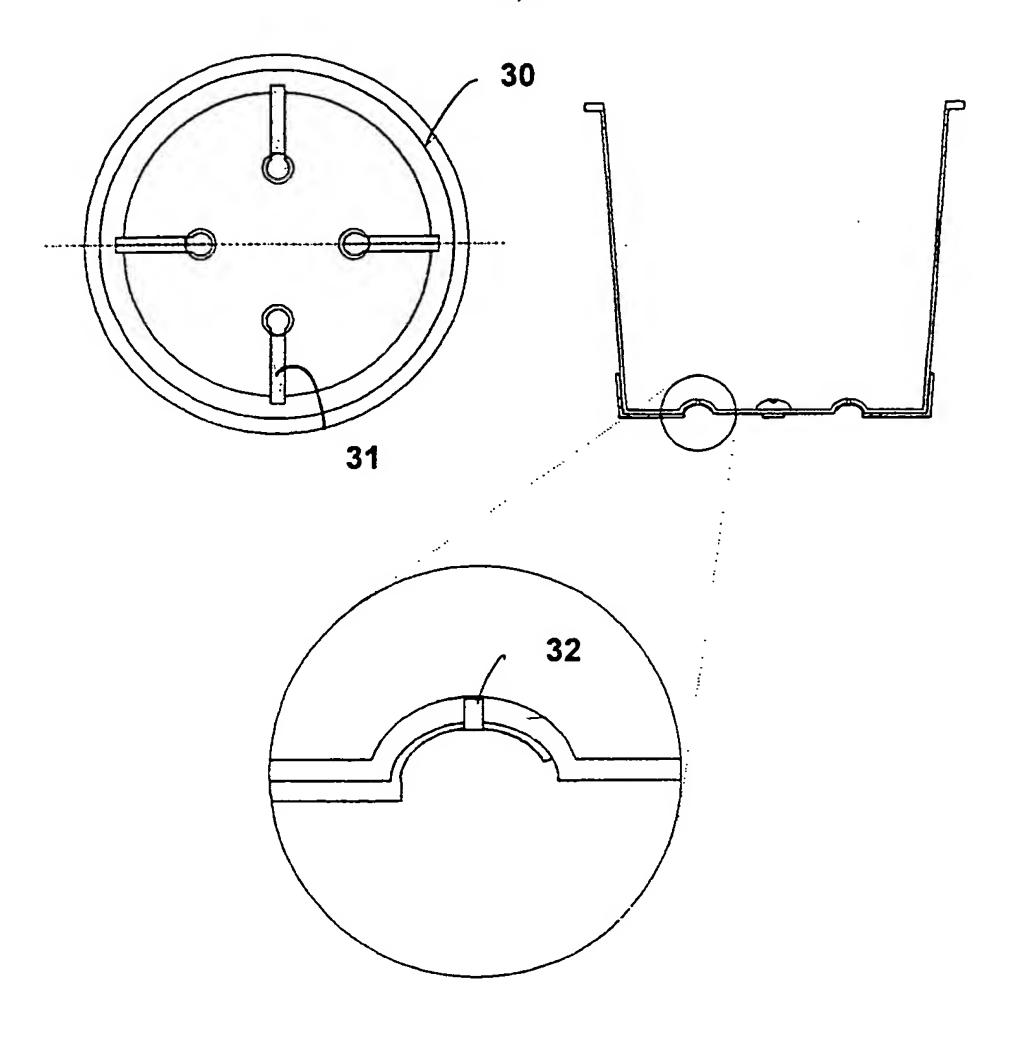


Fig. 4

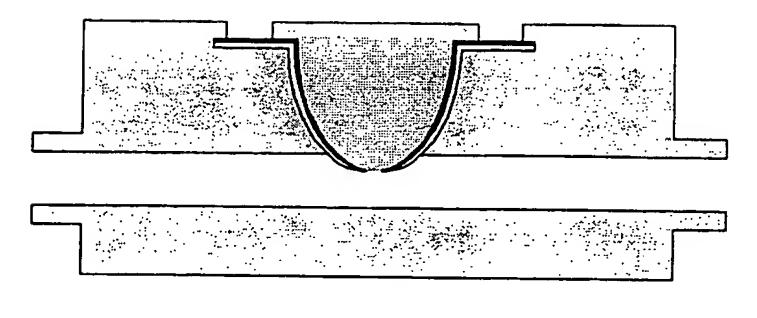
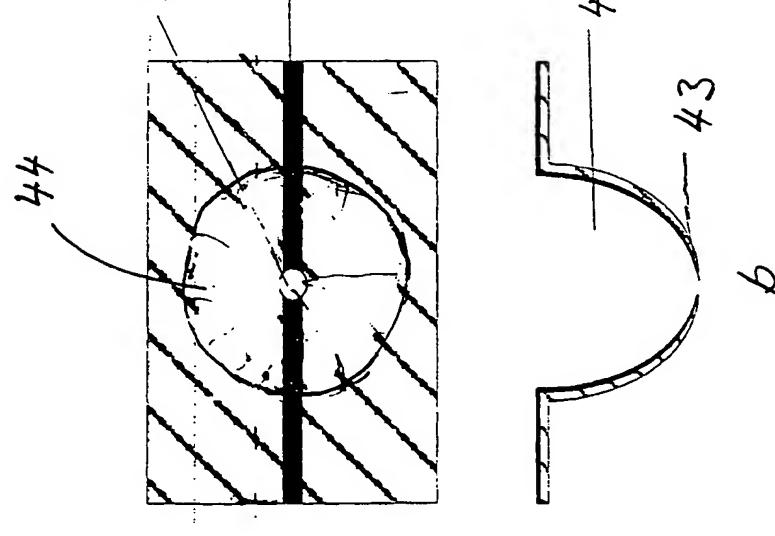
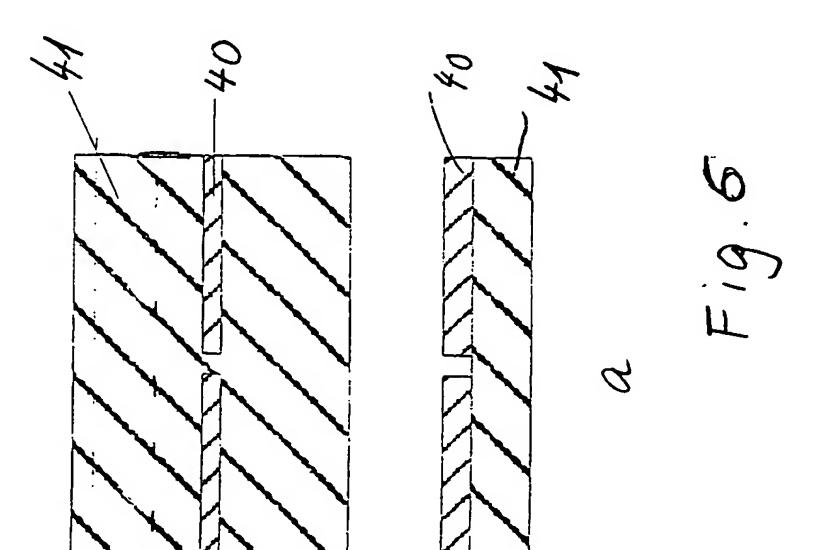


Fig. 5





### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into .ional Application No PCT/EP 01/05032

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01N27/403 H05K1/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B81C G01N H05K B29C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 92 21020 A (KNOLL MEINHARD) 26 November 1992 (1992-11-26) figures 4,7-9 page 14, line 33 -page 15, line 15 page 17, line 26 -page 18, line 34	1,7-14
A	DE 196 06 862 A (HITACHI CABLE ;HITACHI LTD (JP)) 29 August 1996 (1996-08-29) figures 1,2,4-7 page 2, line 61 -page 5, line 48 page 6, line 48 -page 15, line 16	1-6
A	DD 301 930 A (URBAN GERALD; NAUER GERHARD (AT)) 21 July 1994 (1994-07-21) figures 6-9 page 4, line 41 - line 62 page 5, line 37 - line 53	1,7-11, 13,14
	-/	

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> </ul>	<ul> <li>'T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>'&amp;' document member of the same patent family</li> </ul>
Date of the actual completion of the international search  20 August 2001	Date of mailing of the international search report $28/08/2001$
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31–70) 340–2040. Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Polesello, P

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into .ional Application No
PCT/EP 01/05032

		PCT/EP 01/05032
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 730 394 A (IBM) 4 September 1996 (1996-09-04) figure 1 column 2, line 3 - line 18 column 2, line 29 -column 4, line 39	1,3-6
A	EP 0 598 914 A (MITSUI TOATSU CHEMICALS) 1 June 1994 (1994-06-01) figures 1-10 column 3, line 33 -column 6, line 36 column 9, line 34 -column 10, line 25 column 11, line 19 -column 15, line 9	1,2,4,6,13,14
A	US 5 066 372 A (WEETALL HOWARD H) 19 November 1991 (1991-11-19) figures 1-4 column 2, line 26 -column 3, line 15	1,7-10,
	•	

ram Pot new franchismins of commit cheat / fully 10021

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

- .. marked inco common familie annual flishe 1000)

Int. .ional Application No
PCT/EP 01/05032

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
WO 9221020	A	26-11-1992	DE	4115414 A	12-11-1992	
			EP	0538428 A	28-04-1993	
			JP	3111283 B	20-11-2000	
			JP	6500178 T	06-01-1994	
			US	5393401 A	28-02-1995	
DE 1960686	2 A	29-08-1996	JP	8293646 A	05-11-1996	
DD 301930	Α	21-07-1994	AT	403528 B	25-03-1998	
			AT	78389 A	15-07-1997	
			WO	9012314 A	18-10-1990	
			AU	5348790 A	05-11-1990	
			EP	0418359 A	27-03-1991	
			JP	3505785 T	12-12-1991	
EP 0730394	A	04-09-1996	US	5659153 A	19-08-1997	
			CA	2168285 A	04-09-1996	
			CN	1137734 A,B	11-12-1996	
			JP	8250863 A	27-09-1996	
			KR	201033 B	15-06-1999	
			SG	35475 A	01-02-1997	
			TW	417415 B	01-01-2001	
EP 0598914	Α	01-06-1994	DE	69329542 D	16-11-2000	
			DE	69329542 T	08-02-2001	
			KR	260347 B	01-07-2000	
			US	5639990 A	17-06-1997	
			WO	9326142 A	23-12-1993	
			JP	6053621 A	25-02-1994	
US 5066372	 А	19-11-1991	US	4963245 A	16-10-1990	

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intr ionales Aktenzeichen PCT/EP 01/05032

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01N27/403 H05K1/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B81C G01N H05K B29C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 92 21020 A (KNOLL MEINHARD) 26. November 1992 (1992-11-26) Abbildungen 4,7-9 Seite 14, Zeile 33 -Seite 15, Zeile 15 Seite 17, Zeile 26 -Seite 18, Zeile 34	1,7-14
A	DE 196 06 862 A (HITACHI CABLE ;HITACHI LTD (JP)) 29. August 1996 (1996-08-29) Abbildungen 1,2,4-7 Seite 2, Zeile 61 -Seite 5, Zeile 48 Seite 6, Zeile 48 -Seite 15, Zeile 16	1-6
A	DD 301 930 A (URBAN GERALD ; NAUER GERHARD (AT)) 21. Juli 1994 (1994-07-21) Abbildungen 6-9 Seite 4, Zeile 41 - Zeile 62 Seite 5, Zeile 37 - Zeile 53	1,7-11, 13,14
	-/	

	_/
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>A* Veröffentlichung, die den atlgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>E* ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	<ul> <li>'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</li> <li>'&amp;' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
20. August 2001	28/08/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteler Polesello, P

FILLE COTAC FRANCISCH OVER AND FRANCISCO

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Into ionales Aktenzeichen
PCT/EP 01/05032

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile Betr. Anspruch Nr.
EP 0 730 394 A (IBM) 4. September 1996 (1996-09-04) Abbildung 1 Spalte 2, Zeile 3 - Zeile 18 Spalte 2, Zeile 29 -Spalte 4, Zeile 39	1,3-6
EP 0 598 914 A (MITSUI TOATSU CHEMICALS)  1. Juni 1994 (1994-06-01)  Abbildungen 1-10  Spalte 3, Zeile 33 -Spalte 6, Zeile 36  Spalte 9, Zeile 34 -Spalte 10, Zeile 25  Spalte 11, Zeile 19 -Spalte 15, Zeile 9	1,2,4,6,13,14
US 5 066 372 A (WEETALL HOWARD H) 19. November 1991 (1991-11-19) Abbildungen 1-4 Spalte 2, Zeile 26 -Spalte 3, Zeile 15	1,7-10,

# - INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte phales Aktenzeichen
PCT/EP 01/05032

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO 9221020	A	26-11-1992	DE	4115414 A	12-11-1992	
			EP	0538428 A	28-04-1993	
			JP	3111283 B	20-11-2000	
			JP	6500178 T	06-01-1994	
			US	5393401 A	28-02-1995	
DE 19606862	Α	29-08-1996	JP	8293646 A	05-11-1996	
DD 301930	Α	21-07-1994	AT	403528 B	25-03-1998	
			AT	78389 A	15-07-1997	
			WO	9012314 A	18-10-1990	
			AU	5348790 A	05-11-1990	
			EP	0418359 A	27-03-1991	
			JP	3505785 T	12-12-1991	
EP 0730394	Α	04-09-1996	US	5659153 A	19-08-1997	
			CA	2168285 A	04-09-1996	
			CN	1137734 A	,B 11-12-1996	
			JP	8250863 A	27-09-1996	
		·	KR	201033 B	15-06-1999	
			SG	35475 A	01-02-1997	
			TW	417415 B	01-01-2001	
EP 0598914	Α	01-06-1994	DE	69329542 D	16-11-2000	
			DE	69329542 T		
			KR	260347 B	01-07-2000	
			US	5639990 A		
			WO	9326142 A		
			JP	6053621 A	25-02-1994	
US 5066372	Α	19-11-1991	US	4963245 A	16-10-1990	